

# 大容量真空遮断器の開発 - 真空アークの制御 -

丹 羽 芳 充,金 子 英 治<sup>1)</sup> (㈱東芝 電機応用システム開発部,<sup>1</sup>琉球大学電気電子工学科)

# Development of High Interruption Capability Vacuum Circuit Breaker - Technology of Vacuum Arc Control -

# NIWA Yoshimitsu and KANEKO Eiji<sup>1)</sup>

Electrical & Mechanical Application Systems R&D Dept., Toshiba corporation, 1, Toshiba-cho, Fuchu-shi, Tokyo, 183-8511, Japan <sup>1)</sup>Depertment of Electrical and Electronics Engineering, University of the Ryukyus, 1, Senbaru, Nishihara, Okinawa, 903-0213, Japan (Received 12 October 2004)

Vacuum circuit breakers (VCB) have been widely used for power distribution systems. Vacuum Interrupters, which are the current interruption unit, have been increased its interruption capability with the development of vacuum arc control technology by magnetic field. There are three major type electrodes: disk shaped electrodes, radial magnetic field electrodes, axial magnetic field (AMF) electrodes. In the disk shaped electrode, the vacuum arc between the electrodes is not controlled. In the AMF electrode, the vacuum arc is diffused and stabilized by an axial magnetic field, which is parallel to the arc current. In the last type of electrodes, the vacuum arc column is rotated by magnetic force generated by the current flowing in the electrodes. The interruption current and the voltage of one break VCB is increased to 100 kA, 144 kV respectively.

This paper describes basic configurations and functions of VCB, vacuum arc control technology in vacuum interrupters, recent researches and applications of VCB.

Keywords:

vacuum arc, vacuum circuit breaker, vacuum interrupter, magnetic field, current interruption, insulation

# 1.はじめに

遮断器は短絡などの事故が発生した際に,事故電流を遮 断するため用いられている.遮断器には,様々な媒体を用 いたものがある.主なものとしては,六フッ化硫黄(SF<sub>6</sub>), 空気,真空の3種類がある.SF<sub>6</sub>ガスは優れた絶縁性能を 持つことから,送電系統など高電圧の系統で広く用いられ ている.空気はSF<sub>6</sub>ガスや真空より絶縁性能が劣るため, 数 kV 以下の低い電圧の機器で用いられることが多い.そ れに対し,真空は数 10 kV 以下の受配電系統などで広く用 いられている.真空は環境負荷の少ない媒体として,適用 範囲の拡大が期待されている.

真空遮断器(Vacuum Circuit Breaker: VCB)は,遮断部 に真空中で電極を開閉する「真空バルブ」と呼ばれるユニッ トを用いている.真空バルブは,セラミックなどの絶縁物 製の容器内に一対の電極を設け,容器内を10<sup>-4</sup> Pa以下の 真空としている.通電中に真空バルブの電極を遮断器の操 作機構により開くと,電極間にアーク放電が生じる.アー クは電極の接触部に設けられた接点が蒸発し,金属蒸気と なり電極間で電離することで維持されている.電極より放 電の媒体が供給される点が,ガス中での放電と異なってい

る.VCBは安全性の高さや保守点検の容易さなどの利点を 活かして,実用開始から約30年の間に急速な発展を遂げ, 現在では定格電圧 3.6~36 kV の範囲の遮断器では主流と なっている.また,真空バルブの電極間に生じるアークに 磁界を印加し,アークを制御する電極が広く用いられるよ うになって, VCBの大容量化が飛躍的に進んだ.磁界によ るアーク制御の手法により,真空バルブの電極は大きく3 種類に分類される[1].1つは磁界による制御を行わない 平板電極であり,遮断電流の小さい VCB に用いられてい る.2つ目は,縦磁界と呼ばれるアークと平行な磁界を印 加し,アークを電極間に均一に拡散する方法である [24].3つ目は,アークに直角の磁界を印加し,ローレン ツカによりアークを特定の位置に停滞しないように駆動す る方法である[57].また,縦磁界方式を改良し,より遮断 性能を向上した自発拡散と呼ばれる方式が開発された [89].さらに,外部回路により強制的に電流を零として遮 断する VCB の研究開発が進められており[10,11], 重要負 荷や自家発電機を持つ系統や,電車に電力を供給する直流 系統に適用されている.

本解説では,一般的な VCB とその適用状況,最近の研

author's email: yoshimitsu.niwa@toshiba.co.jp, kaneko@eee.u-ryukyu.ac.jp

究,大容量化,高電圧化技術を紹介する.

#### 2.真空遮断器の基礎

一般的な3相交流用のVCBの一例をFig.1に示す.真空 遮断器は,遮断部である真空バルブと,真空バルブの電極 を開閉する操作機構,回路と接続する導体からなる.真空 バルブはFig.2のような構造となっている.外形は円柱形 で,セラミックスなど絶縁物の円筒内に一対の電極が設け られている.一方の電極は回路を開閉できるように,導体 にベローズが設けられており,電極が軸方向に動かせる構 造となっている.電流遮断のためにロッドを動かし,電極 間の接触を開放した際に電極間に生じるアークは,電極か ら生じた金属蒸気により構成されている.この金属蒸気の 一部が容器の内壁に付着すると,電極間の絶縁耐力が低下 するため,電極の周囲をシールド呼ぶ金属円筒で蔽い,絶 縁耐力の低下を防止している.

電極にはアークの制御方法により大きく分けて3種類が ある.3種類の電極の概略図をFig.3に,それぞれの電極 でのアークの画像をFig.4に示す.平板電極と縦磁界電極 では,電流ピークでのアークの画像を,磁気駆動電極では アークが電磁力により駆動される様子がわかるように 0.5 msごとで3コマの画像を示す.3種類の電極のうち1 つ目は,アークを制御しない平板電極である[1].ピンチ力 により集中したアークによる電極の損傷が生じやすく,大 電流が遮断できないため,遮断容量が小さい真空バルプの 電極として用いられている.2つ目は,縦磁界電極である



Fig. 2 Inner view of vacuum interrupter.

[24]. 電極に流れる電流により電極間にアーク中を流れ る電流と平行な向きの磁界を印加することにより、電極間 のアークを拡散させ均一な分布とする.アークによる電極 への熱入力が均一となり,電極の損傷や温度上昇を低減で きるため,大電流の遮断が可能であることから,大容量の 真空バルブに用いられている.3つ目は,アークを特定の 位置に停滞しないように電磁力により駆動する磁気駆動電 極である[57]. Fig. 3(c)では一例としてカップ型の電極に スリットを設けたコントレート電極と呼ばれるものを示し た.縦磁界電極ではアークを拡散させ均一な分布としたの に対し, ピンチカにより集中状態にあるアークをローレン ツ力により駆動する.このようにすると,アークによる電 極の局所的な損傷や加熱を防げるため、温度上昇を低減で きる.磁気駆動電極には主にコントレート型,スパイラル 型と呼ばれるものがある.どちらの電極においても,電極 に流れる電流により電極間のアークに半径方向の磁界を印



Fig. 3 Electrode configuration. (a) Disk shaped electrode, (b) axial magnetic field electrode, (c) contrate electrode.

Commentary

Development of High Interruption Capability Vacuum Circuit Breaker

Y. Niwa and E. Kaneko



(c)

Fig. 4 Arc appearances. (a) Disk shaped electrode, (b) axial magnetic field electrode, (c) contrate electrode.



Fig. 5 13.8kV - 100kA VCB.

加し,この磁界とアークに流れる電流によるローレンツ力 により,アークを電極の円周方向に駆動する.

次に各種 VCB を紹介する.まず,遮断電流の大きい3相 交流 VCBの例として定格電圧13.8 kV 定格遮断電流100 kA の大容量の VCB を Fig.5 に示す[12].真空バルブに縦磁界 電極を用いることで大電流遮断が可能となった.

絶縁技術の進歩により VCB の高電圧化が進んでいる.高 電圧 VCB では,これまで複数の真空バルブを直列接続して いたが,1本の真空バルブで対応できるようになりつつあ る.84 kV クラスでも3相交流のそれぞれの相を1本の真 空バルブとした VCB がよく用いられるようになっている. 定格電圧 84/72 kV のキュービクル型ガス絶縁スイッチギ ヤ(Cubicle type Gas Insulated Switchgear: C-GIS)の写真



Fig. 6 84/72kV Cubicle type Gas Insulated Switchgear(C-GIS).



Fig. 7 DC VCB for Tokamak nuclear fusion system JT-60.



Fig. 8 Prototype DC250kV circuit breaker.

を Fig.6 に示す[13].スイッチギヤは,VCB,断路器,接 地装置といったスイッチが収められた受配電機器である. このスイッチギヤは,工場やビルなど大口需要家の受電用 に広く用いられている.SF<sub>6</sub>ガス絶縁,絶縁物とSF<sub>6</sub>ガスに よる複合絶縁の適用により小型化を図っている.さらに高 電圧の遮断器への適用例としては,定格電圧145 kVの VCB がある[14].

遮断器では,電流が零とならないと電流を遮断すること ができない.そこで,直流電流を遮断する場合は,外部回 路により,遮断する電流と逆向きの電流を真空遮断器に注 入することにより,電流を零として遮断している.核融合 実験装置用の直流 VCBで,DC44 kV - 130 kA の遮断に成 功している.日本原子力研究所の核融合実験装置 JT-60 で用いられている直流 VCBの写真を Fig.7 に示す[15].電 力系統で用いられている直流遮断器の一例として,本州-



Fig. 9 Circuit of high speed VCB.



Fig. 10 Typical current wave forms.

北海道間の250 kV 直流送電系統で用いられている直流 VCBをFig.8に示す[16].高電圧に耐えられるようにVCB とSF<sub>6</sub>ガス遮断器を直列接続している.

このように VCB は,交流の大容量,高電圧遮断器だけではなく,直流遮断器などへ適用範囲が広がっている.

## 3.真空アークの最新研究動向

重要負荷を持つ需要家は,ガスタービンなど自家発電機 を設置するようになっている.このような発電機をもつ系 統では,発電機の保護のため,事故が発生し,事故電流が 流れ始めてから遮断までの時間を商用周波数の1/2~1/4 サイクル以内と短くすることが望ましい.また,電車に電 力を供給する電鉄の直流系統では,直流であるため電流は 零とならない.一般的な遮断器では,電流が零となるまで, 電流を遮断できないため,事故発生から遮断までの時間短 縮には限界があり,直流電流が遮断できないといった欠点 がある.そこで,遮断器を高速で開極し,外部回路により 真空遮断器に遮断電流と逆向きの高周波電流を注入し,電 流を零とする遮断器が検討されている[10,11]. 遮断器構 成の一例と, 電流波形はそれぞれ Fig. 9, Fig. 10 のように なる.このような遮断方法を採用した VCB は,重要負荷や 自家発電機の保護用や,電鉄の直流系統用として使用され ている.

遮断までの時間を短縮する場合,電極開極から遮断まで の時間が短くなることから,真空バルブの電極開極直後に おけるアーク状態の把握が重要である.電極間のアークの 変化を Fig. 11 に示す.事故を想定した電流を通電している 際に,電極を開極し,高速度ビデオカメラによりアークを









Fig. 11 Arc appearance. (a)Axial magnetic field electrode, (b) diskshaped electrode.

撮影した.左側に開極からの時間を示した.縦磁界電極で は,はじめアークは集中しているが,縦磁界の効果により 電極間全域に拡散している.平板電極では,アークは狭い 領域に集中した状態が継続している.

電極開極直後のアークの輝度分布をこの2種類の電極で 比較した.アークの画像ではどちらの電極でもアークが狭 Development of High Interruption Capability Vacuum Circuit Breaker

1.2 Disk-shaped, Anode Disk-shaped, Cathode Disk-shaped, Cathode AMF, Anode AMF, Cathode 0.4 0.2 0 -1 -0.5 0 0.5 1 Position along electrode surface [PU.]

Fig. 12 Distribution of arc luminosity.



(b)

Fig. 13 Arc appearances. (a)Axial magnetic field electrode, (b)Self Arc Diffusion by Electrode (SADE).

い領域に集中しているように見えるが, Fig. 12 より縦磁界 電極では縦磁界の効果によりアークの集中が抑制されてい ることがわかる.これより,強制的に電流を零として短時 間で電流を遮断する VCBには,縦磁界電極が適していると いえる.

### 4.真空遮断器の大電流化技術

電極間のアークの磁界制御による大電流遮断性能の向上 について述べる.真空バルブの電極として用いられている 縦磁界電極はアークを縦磁界により均一に拡散することが できるため,高い遮断性能が得られる.ところが,遮断電 流をさらに高くしていくと Fig. 13(a)のように,磁界の高い 電極中央部でアークが集中していく、そこで、縦磁界電極 においてもアークが集中する大電流で,アークを Fig. 13(b) のように均一に拡散することができる方法が検討された [89]. 縦磁界電極では Fig. 14(a)のように電極中央で磁界 が高いのに対し,磁界分布を Fig. 14(b)のように電極端部で 高く,中央で低くなるようにする電極が考案された.この 電極は自発拡散電極 (Self Arc Diffusion by Electrode: SADE)と呼ばれている.縦磁界電極と自発拡散電極の アークの発光強度分布を Fig. 15 に示す.遮断電流は自発拡 散電極のほうが大きいが,縦磁界電極ではアークがアノー ド側で電極中央に集中しているのに対し, 自発拡散電極で



Y. Niwa and E. Kaneko

Fig. 14 Axial magnetic flux density distribution between electrodes. (a)Axial magnetic field electrode, (b)Self Arc Diffusion by Electrode (SADE).





は電極間の全域に広がっている.同一の電極サイズでの遮 断性能は,自発拡散電極では従来の縦磁界電極の約2倍を 達成した(Interruption current 12.5 25 kA).

## 5.真空遮断器の高電圧化技術

VCB の高電圧化には,真空バルブ内部と,外部の絶縁性 能の向上が必要である.まず,真空バルブ内部の真空中の 絶縁技術について,次に真空バルブ外部の絶縁技術について述べる.

真空バルブ内部で絶縁性能が要求される箇所は,電極 間,シールド-電極・通電軸間などの真空ギャップ,絶縁 物製の容器表面である.これらのうち,真空ギャップにつ いての絶縁破壊について紹介する.真空中の絶縁破壊で は,絶縁破壊を繰り返していくと破壊電圧が上昇するコン ディショニング効果という特徴的な現象が知られている [17,18].真空バルブの製造工程において,この効果を利用 した処理が用いられている.絶縁破壊を繰り返すことによ り,電極表面の一部が溶融し,吸着ガスや付着物が除去さ れ,表面が清浄化される.さらに,溶融されることにより, 微小突起が除去され表面が平滑化され,電界放射による電 子放出が抑制される.表面加工方法が異なる電極での絶縁 破壊の回数と破壊電圧の関係を Fig. 16 に示す.加工方法に より表面粗さが異なっており,複合電界研磨の方が機械加 工より表面が滑らかである.表面が滑らかな方が,コン ディショニングが早く完了することがわかる.

高電圧真空バルブの小型化の一例として 84 kV 用真空バ ルブの変遷を Fig. 17 に示す.真空中の絶縁技術,大電流遮 断技術の向上により,真空バルブの小型化が進んだ.

次に真空バルブ外部の絶縁について紹介する.SF<sub>6</sub>ガス は温暖化効果が高いことから,他の絶縁方法が検討されて いる.その一つとして,固体絶縁技術,固体絶縁と気中絶 縁を組み合わせた絶縁技術の研究開発が進められ,すでに



Fig. 16 Conditioning effect for breakdown voltage.



year

Fig. 17 Size reduction history of vacuum interrupter for 84kV - 31.5 kA.

#### 製品に適用されている.

固体絶縁と気中絶縁を複合した絶縁方法の基礎研究の一 例を紹介する[19].金属電極の先端をエポキシでモールド し,空気中で電極間にギャップを設けた Fig. 18 のような装 置で,絶縁特性を調べた.絶縁破壊時の放電の写真を Fig. 19 に示す.金属電極,絶縁物沿面,気中ギャップ,絶 縁物,金属電極の経路で放電が生じている.金属電極先端 のエポキシモールドの効果を調べるため,電極間のギャッ プと絶縁破壊電圧,部分放電発生開始電圧の関係を Fig. 20 に示す.エポキシモールドを設けると絶縁破壊電圧と部分 放電開始電圧の両方が向上することがわかる.このこと は,固体絶縁と気中絶縁を複合することにより,絶縁性能 が向上することを示している.

固体絶縁と複合絶縁を適用した固体絶縁スイッチギヤ (Solid Insulated Switchgear: SIS)の断面図をFig.21に示す [19 20].SISは、絶縁媒体としてSF6ガスを全く使用して いない.SF6ガスを用いているC-GISと比較して、重量半 減、体積40%縮小を達成した.VCB、真空断路器(Vacuum Disconnect Switch: VDS)や導体をエポキシで絶縁し、表面 を接地電位としている.VCBとVDSの真空バルブとこれ らを開閉する操作機構の接続部分に固体絶縁と気中絶縁の 複合絶縁が適用されている.SF6ガスは地球温暖化係数が







Fig. 19 Discharge channel of molded electrode (gap length L = 30 mm).



Fig. 20 Relationship between partial discharge inception voltage, dielectric breakdown voltage and gap length.



Fig. 21 Inner configuration of 24 kV solid insulated switchgear.

炭酸ガスの 23,900 倍と高いことから,1997年に開催された 地球温暖化防止会議(COP3)にいおいて,排出規制ガス に指定された.SISは脱SF<sub>6</sub>ガスに成功したスイッチギヤの 一つである.

# 6.まとめ

VCBは,真空アークの磁界による制御技術や絶縁技術の 研究開発により,大容量化,高電圧化が進み,さらに適用 範囲が広がっている.また,外部回路により強制的に電流 を零とすることにより交流電流や直流電流を事故発生から 短時間で遮断する新しいVCBの普及も進んでいる.真空は 環境負荷の少ない媒体として期待されているが,適用範囲 の拡大には真空中の放電現象の解明が重要である.

# 参考文献

- [1] A. Greenwood, "Vacuum switchgear", IEE Power Series 18, London, U.K. (1994).
- [2] S. Yanabu et al., Proc. IEE 126, No. 4, 313 (1979).
- [ 3 ] M. Okawa *et al.*, IEEE Trans. Power Deliv. PWRD-2, No.3, 805 (1987).
- [ 4 ] K. Watanabe *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. 25, No.4, 609 (1997).
- [ 5 ] M. Bruce Shulman *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. 21, No.5, 484 (1993).
- [ 6 ] Wilfried Hass et al., IEEE ISDEIV 1998 (1998) p.274.
- [7] J. Teichmann *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. 27, No.4, 484 (1999).
- [ 8 ] M. Homma *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. 27, No.4, 961 (1999).
- [9] Y. Niwa et al., IEEE Winter Meeting 2000 (2000).
- [ 10 ] Y. Niwa et al., IEEE PES T&D Conference 2002, Yokohama, Japan (2002) p.1786.
- [11] Y. Niwa et al., IEEE ISDEIV 2002 (2002) p.435.
- [12] S. Sunada et al., CIGRE 1982 Session, Report 13-04 (1982).
- [13] T. Shioiri *et al.*, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 6, No.4, 486 (1999).
- [14] M. Homma et al., IEEE ISDEIV 2004 (2004) p.378.
- [ 15 ] R. Tamura *et al.*, IEEE Trans. PAS, Pas-99, No3, 1119 (1989).
- [ 16 ] T. Senda *et al.*, IEEE PES Summer Meeting 83, SM501-4 (1983).
- [17] T. Shioiri et al., 8th ISH (1993) p.473.
- [ 18 ] T. Shioiri et al., J.Vac. Soc. Jpn. 43, No.1, 18 (2000).
- [19] J. Sato *et al.*, IEEE PES T&D Conference 2002, Yokohama, Japan (2002) p.1791.
- [ 20 ] J. Sato et al., IEEJ ED-03-170 (2003).



金子英治

1952年9月16日生.1977年4月名古屋大学 大学院博士課程前期課程修了.同年4月東 京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入 社,真空放電,真空遮断器の研究開発に従

事.2002年4月琉球大学工学部助教授,現在に至る.電磁エ ネルギー工学講座に所属,電気エネルギーシステムの総合的 な研究,教育に従事.放電学会,電気設備学会,応用物理学 会,IEEE 会員.工学博士.